

ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БАРЬЕРОВ ЭЛЕКТРОЛИТ—CdGeP₂

Горячев Д. Н., Рудь Ю. В., Таиров М. А.

Исследованы фотоэлектрические процессы на энергетическом барьере, возникающем на границе *n*-*p*-CdGeP₂ с электролитом. Получены выпрямляющие фоточувствительные в области фундаментального поглощения тройного фосфида структуры. Обнаружена поляризационная фоточувствительность ячеек. Показано, что поляризационные параметры ячеек определяются анизотропией фотоактивного собственного и примесного поглощения CdGeP₂. Сделан вывод о возможности практического применения изученных энергетических барьеров.

Тройные соединения II—IV—V₂, как показали развернутые недавно первые исследования процессов фотопреобразования на границе этих веществ с электролитами [1, 2], дают возможность расширить функциональный диапазон приборов полупроводниковой электроники. До сих пор влияние физических свойств II—IV—V₂ на фотоэлектрические параметры их контакта с электролитами не анализировалось. В данной работе рассмотрены первые результаты таких исследований, выполненные на одном из наиболее перспективных среди II—IV—V₂ полупроводников — кристаллах CdGeP₂ *n*- и *p*-типа проводимости.

Исследовались фотоэлектрические процессы на границе монокристаллов CdGeP₂ *n*- и *p*-типа проводимости с разбавленными растворами индифферентных электролитов (например, 0,001 *n*H Na₂SO₄, дистиллированная вода). Типичные вольтамперные и спектральные характеристики ячеек приведены на рис. 1—4, а их параметры — в таблице. ВАХ измеряли с помощью потенциостата П-5848

Фотоэлектрические параметры ячеек на основе CdGeP₂ (300 К)

Вещество фотоэлектрода	$ R \frac{e}{\text{см}^{-2}}$	$U_{\text{хр.}}$, мВ	$i_{\text{кз}}$, мкА	S , эВ ⁻¹	$\Delta h\nu_m$, эВ	η^m , %	$\eta_{\text{э.м.}}$, эВ
<i>p</i> -CdGeP ₂ <легир.>	10 ¹⁰	+25	≤ +0.1	32	2.6 ÷ 3.2	82	1.72
<i>p</i> -CdGeP ₂ <Cu>	10 ¹¹	+200	+0.5	25	—	80	1.72
<i>p</i> -CdGeP ₂ <Ga>	10 ¹⁵	+350	+1.0	27	~ 2.55	82	1.72
<i>n</i> -CdGeP ₂ <In>	10 ¹³	-400	-1.1	27	> 2.4	78	1.70

в потенциостатическом режиме относительно медного контрэлектрода большой площади при скорости развертки ≈ 40 мВ/с. Периодически рабочий электрод освещался лампой накаливания с плотностью потока ≈ 1 Вт/см² и длительностью $t_n \approx 1$ с. Микроскопические исследования поверхности монокристаллов *n*- и *p*-типа проводимости после непрерывного и длительного (≈ 30 ч) процесса фотопреобразования не обнаружили каких-либо изменений. В спектральных исследованиях фоточувствительности использовались ячейки с платиновым контрэлектродом, освещение линейно поляризованным излучением осуществлялось со стороны электролита вдоль нормали к плоскости (100) фотоэлектрода. Изменение концентрации электронов и дырок в образцах CdGeP₂ осуществлялось за счет легирования различными примесями [3].

Исследования ВАХ показывают, что наиболее четко выпрямляющие свойства выражены в ячейках с фотоэлектродом из вещества *n*-CdGeP₂<In>. Вы-

прямление таких ячеек в отсутствие освещения обычно достигало уровня $10^4 \div 10^5$ при напряжениях $U \approx 5$ В. В случае использования легированных границы существенно ухудшались. Например, выпрямление ячеек из легированных медью кристаллов резко снижалось до $2 \div 5$ при $U \leq 5$ В. Во всех ячейках пропускное направление определяется типом проводимости CdGeP_2 . Максимальные по абсолютной величине фототоки (см. таблицу) достигнуты в ячейках из кристаллов $p\text{-CdGeP}_2\langle\text{Ga}\rangle$ и $n\text{-CdGeP}_2\langle\text{In}\rangle$, т. е. содержащих примеси, которые позволяют получить наиболее легированные в настоящее время образцы n - и p -типа CdGeP_2 . В целом следует отметить, что стадио-

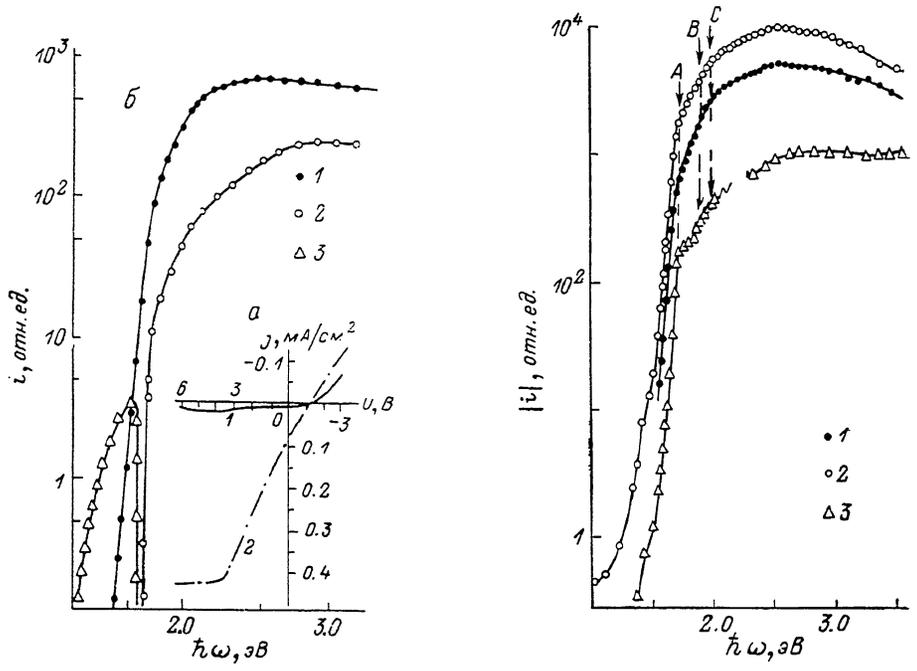


Рис. 1.

a — вольтамперные характеристики фотоэлектрохимической ячейки на основе монокристалла $n\text{-CdGeP}_2\langle\text{In}\rangle$; $T=300$ К; 1 — темновая ВАХ, 2 — при освещении интегральным светом с плотностью ≈ 1 Вт/см²; электролит 0.001 рН Na_2SO_4 ; пропускное направление отвечает минусу на CdGeP_2 ; *b* — спектральные зависимости фоточувствительности барьера на границе $n\text{-CdGeP}_2\langle\text{In}\rangle$ с дистиллированной водой; $T=300$ К; неполяризованный свет; 1 — заборное направление $U_{\text{обр}}=4.5$ В; 2, 3 — пропускное направление $U_{\text{обр}}=-4.5$ В. Полярность фототока: 1, 3 — плюс, 2 — минус. Указана полярность фотоэлектрода; спектральное разрешение не хуже 1 мэВ.

Рис. 2. Спектральные зависимости фототока барьера на границе $\text{H}_2\text{O}-\text{CdGeP}_2$ в неполяризованном свете при $U=0$.

$T=300$ К. Вещество фотоэлектрода: 1 — $n\text{-CdGeP}_2\langle\text{In}\rangle$, 2 — $p\text{-CdGeP}_2\langle\text{Ga}\rangle$, 3 — $p\text{-CdGeP}_2$; полярность фототока на CdGeP_2 : 1 — минус, 2, 3 — плюс. Спектральное разрешение не хуже 1 мэВ; освещение со стороны H_2O ; стрелками А, В и С указаны значения энергии межзонных оптических переходов в CdGeP_2 [1].

нарные и световые ВАХ фотоэлектрохимических ячеек из $\text{CdGeP}_2\langle\text{In}\rangle$ (рис. 1, *a*) оказались подобными получаемым на таких же исходных кристаллах гетероструктурам $n\text{-SnO}_2-n\text{-CdGeP}_2\langle\text{In}\rangle$ [4]. Из особенностей обратных ВАХ фотоэлектрохимических ячеек отметим наличие четко фиксируемого при использовании легированных кристаллов максимума темнового тока в области $U_{\text{обр}} \approx 3 \div 4$ В, который в меньшей степени проявился в ячейках из $\text{CdGeP}_2\langle\text{In}\rangle$ (рис. 1, *a*). Причиной этой особенности еще не ясна.

При освещении ячеек со стороны электролита генерируется фотонапряжение $U_{\text{хх}}$, знак которого для фотоэлектродов n -типа проводимости отвечает минусу, а p -типа — плюсу. Наиболее высокие значения $U_{\text{хх}}$ получены при использовании легированных кристаллов n - и p -типа. Максимальная вольтовая фоточувствительность таких ячеек достигает $S_V \approx 10^5$ В/Вт при 300 К.

Из спектров фоточувствительности ячеек следует, что фототок короткого замыкания, возникающий под действием генерируемого на таких барьерах фото-

напряжения, течет в пропускном направлении во всей спектральной области фоточувствительности, которая оказалась такой же, что и в гетероструктурах из кристаллов с такими же электрофизическими параметрами [4]. Эти обстоятельства дают основания считать, что фотоактивная область структур электролит— CdGeP_2 локализована в полупроводнике.

Из исследований фототока ячеек также следует, что спектральный контур i хорошо воспроизводим и не обнаруживает каких-либо изменений во времени, что подтверждает вывод [1] о высокой устойчивости CdGeP_2 в отношении фотокоррозии. Длинноволновый край $i(\hbar\omega)$ во всех ячейках экспоненциален и характеризуется крутизной $s=d(\ln i)/d(\hbar\omega)$, которая типична для спектров фотоактивного поглощения однородных кристаллов CdGeP_2 с аналогичным уровнем легирования и твердотельных структур из них [3, 4]. Для ячеек из $\text{CdGeP}_2(\text{In})$ спектральное положение экспоненциального края $i(\hbar\omega)$ на 40–60 мэВ смещено относительно спектров для ячеек из нелегированного

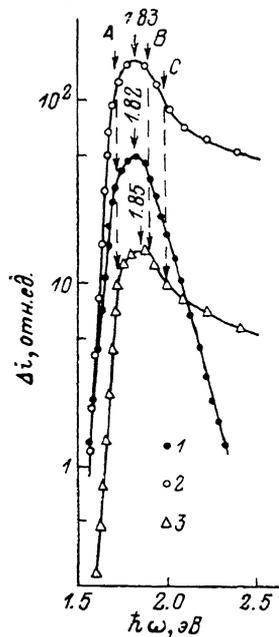


Рис. 3. Спектральные зависимости поляризационной разности фототока Δi ячеек $\text{H}_2\text{O}-\text{CdGeP}_2$.

$T=300$ К; ориентация пластин (100); стрелки А, В и С указывают энергии межзонных переходов в CdGeP_2 , согласно [3]. 1 — $n\text{-CdGeP}_2(\text{In})$, 2 — $p\text{-CdGeP}_2(\text{Ga})$, 3 — $p\text{-CdGeP}_2$.

вещества, что объясняется оптическими переходами с участием донорных уровней индия.

Главной закономерностью спектров $i(\hbar\omega)$ ячеек является рост фототока в глубине фундаментального поглощения CdGeP_2 , так что максимальная фото-

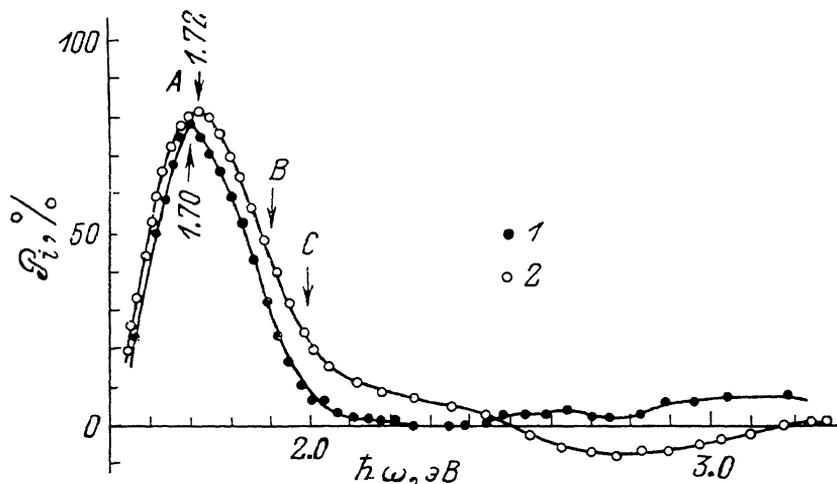


Рис. 4. Спектральные зависимости коэффициента естественного фотохроизма ячеек $\text{H}_2\text{O}-\text{CdGeP}_2$.

$T=300$ К; ориентация пластин (100); вещество фотоэлектрода: 1 — $n\text{-CdGeP}_2(\text{In})$, 2 — $p\text{-CdGeP}_2(\text{Ga})$. Стрелки А, В и С указывают энергии межзонных переходов в CdGeP_2 , согласно [3].

чувствительность реализуется при энергиях фотонов, которые существенно больше ширины запрещенной зоны CdGeP_2 . Например, в ячейках $\text{H}_2\text{O}-\text{CdGeP}_2(\text{Ga})$ максимум фототока (рис. 2) достигается вблизи $\hbar\omega_m \approx 2.55$ эВ, тогда как в случае легированных индием и нелегированных фотоэлектродов максимальный фототок наблюдается в более широкой области энергий фотонов $\Delta\hbar\omega_m$ (см. таблицу), т. е. коротковолновый спад i в таких

структурах выражен слабо. Если учесть, что создание на CdGeP_2 твердотельных структур с аналогичным спектральным контуром $i(\hbar\omega)$ без коротковолнового спада фототока требует воспроизведения определенных технологических условий, а в случае ячеек нужно только ввести кристалл в контакт с электролитом, то преимущества последних становятся неоспоримыми.

Спектры фототока обратно смещенных ячеек (рис. 1, б, кривая 1) аналогичны рассмотренным для случая $U=0$ (рис. 2). Для прямо смещенных структур (рис. 1, б, кривые 2, 3) в спектре i возникает инверсия знака фототока, что обусловлено конкуренцией фотопроводимости объема CdGeP_2 и фотонапряженной барьера электролит—полупроводник ($i=i_0-i_{\text{ФП}}$). В точке инверсии реализуется случай $i=0$, и ее спектральное положение может плавно управляться напряжением прямого смещения.

При освещении ячеек линейно поляризованным излучением вдоль нормали к освещаемой плоскости (100) CdGeP_2 наблюдается поляризационная фоточувствительность, которая подчиняется характерным для фотоактивного поглощения в тройном соединении и структурах на их основе закономерностям [4, 5]. Поляризационная индикатриса фототока во всей области поляризационной фоточувствительности ячеек следует обобщенному закону Малюса [5], и положение ее экстремумов совпадает с положением главных кристаллографических осей [100] и [001]. Поляризационная разность фототока ячеек $\Delta i = i^{\parallel} - i^{\perp}$, где i^{\parallel} и i^{\perp} — фототоки для $E \parallel c$ и $E \perp c$ (рис. 3), в соответствии с правилами отбора для межзонных A -переходов в CdGeP_2 [5] положительна и достигает максимума в диапазоне $1.82 \div 1.85$ эВ, что находится между значениями энергий A - и B -переходов. При использовании в качестве фотозлектродов нелегированных или содержащих примесь галлия кристаллов CdGeP_2 коротковолновый спад Δi менее выражен относительно $\text{CdGeP}_2\langle\text{In}\rangle$ (рис. 3). Длинноволновая граница Δi характеризуется экспоненциальным законом и обусловлена наступлением прямых A -переходов. Следует также подчеркнуть, что спектры Δi для ячеек опять-таки сходны с наблюдаемыми в твердотельных поляриметрических структурах [4].

На рис. 4 приведены типичные спектры естественного фотоплетохроизма \mathcal{P}_i ячеек из легированных монокристаллов CdGeP_2 . По знаку и абсолютным значениям \mathcal{P}_i такие структуры не уступают гетеропереходным [4]. Закономерности фотоплетохроизма ячеек следующие. Фотоплетохроизм максимален и положителен вблизи энергии A -переходов; небольшое смещение $\hbar\omega_{\mathcal{P}_i}$ (см. таблицу) в ячейках $\text{H}_2\text{O}-\text{CdGeP}_2\langle\text{In}\rangle$ в длинноволновую область связано с анизотропией фотоактивного примесного поглощения, которая четко проявляется и в других процессах, например в фотолюминесценции $\text{CdGeP}_2\langle\text{In}\rangle$. Характерно, что в глубине фундаментального поглощения CdGeP_2 ($\hbar\omega > 2$ эВ) естественный фотоплетохроизм ячеек низок, и его величина не выходит за пределы точности определения \mathcal{P}_i .

С учетом достигнутых на изученных структурах поляризационных параметров следует, что фотозлектрохимические ячейки из легированных индием и галлием кристаллов CdGeP_2 позволяют обеспечить максимальную азимутальную фоточувствительность $\Phi_L \approx 2 \cdot 10^3$ В/Вт·град вблизи $\hbar\omega \approx 1.83$ эВ при 300 К.

Л и т е р а т у р а

- [1] Scorati B., Fornarini L. // J. Electrochem. Soc. 1984. V. 131. N 4. P. 948—949.
- [2] Рудь Ю. В., Таиров М. А. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 4. С. 615—619.
- [3] Прочухан В. Д., Рудь Ю. В. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 2. С. 209—233.
- [4] Лунев А. В., Рудь Ю. В., Таиров М. А., Удалов Ю. К. // Препринт ФТИ АН СССР. Л., 1987. № 1147.
- [5] Рудь Ю. В. // Изв. вузов СССР. Физика. 1986. Т. 29. В. 8. С. 68—83.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Получена 21.04.1988
Принята к печати 28.09.1988.